(9) 日本国特許庁(JP)

② 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-200639

⑤Int. Cl. 4
H 01 L 21/52

⑪出 願 人

識別記号

庁内整理番号 C-8728-5F ④公開 平成1年(1989)8月11日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

3発明の名称 ダイボンデイング方法

②特 願 昭63-25267

②出 願 昭63(1988) 2月4日

⑩発 明 者 岡 村

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

郊代 理 人 弁理士 内 原 晋

明 細 舊

発明の名称
 ダイボンディング方法

2. 特許請求の範囲

ボンディングアームに散けられたコレットが、 ダイを吸着保持して、彼ボンディング材のボンディング面より僅か上方へ前記ダイを移送し、前記 ボンディング面と前記ダイとの間に僅かな隙間を 特せた位産で、前記ダイの吸着保持状態を解放して前記コレットと前記ダイとを分離した後、前記 コレットと前記ダイとが接近して前記被ボンディング材のボンディング面上で前記ダイを押圧保持 し、スクラブ動作を行い、ダイボンディングを終 了するととを特徴とするダイボンディング方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はダイボンディング方法に係り、特に半

導体案子(以下ダイと略称)を被ポンディング材 に接合する為のダイポンディング方法に関する。 「従来の技術〕

従来、半導体製品の製造過程において、第6図に示すように、ダイ1を被ボンディング材2のポンディング面に接合する場合、ダイ1の裏面と、被ポンディング材2のダイ接合面との間に、金(Au)ーシリコン(8i)共晶構造を形成するように、コレット5により吸着保持し、ボンディング面上に載置された状態で、ダイ1に対してスクラブ動作(周波数2~5Hz)を与えている。

その場合、ダイ吸着用コレット5を支持するポンディンクアームをカム(図示せず)で被ポンディング材2と相対的にスクラブ動作を与え、そのスクラブ動作により、Au-Si共晶によるダイポンディングを行っている。

[発明が解決しようとする問題点]

前述した従来のダイポンディング装置では、特に大形のダイ1の場合には、コレット5に吸着されてきたダイ1が僅かでも被ボンディング材2の

ボンディング面3と平行状態から、外れて供給されると、コレット5のテーバ部14とダイ1表面のコーナ15との接触の長さが大きくなり、ダイ1は容易にはボンディング面3と密着状態を作れない。このため、Au-Si共晶が記らず、また無理して、スクラブ動作を行うと、ダイ1の割れや欠け等を生じる。

また、この様にAu-Si共晶が不十分となり、 良好な接合状態が得られなかった場合、接合状態 の自動検出は現状では不可能である為、不良品を 多数作ってしまり欠点がある。

本発明の目的は、前記欠点が解決され、割れや 欠け等の事故が生じず、良好なダイー被ポンディ ング材の接合状態が得られるようにしたダイボン ティング方法を提供することにある。

〔問題点を解決するための手段〕

本発明のダイボンディング方法の構成は、ボン ディングアームに設けられたコレットか、ダイを 吸着保持して、被ボンディング材のボンディング 面より僅か上方へ前記ダイを移送し、前記ボンデ

しない)ダイ供給位置から、被ポンディング材 2 のボンディング面 3 の中に移送することができる。

また上下駆動手段 6 , 前後駆動手段 7 を搭収したベース 8 が、このベース 8 に取付けられた支柱 9 のカムフォロワ 1 0 が、スクラブ運動を与えるカム曲線を持つカム 1 1 の回転でスクラブ運動を行うことにより、ポンディングアーム 4 はスクラブ運動を得る。

また、ダイボンディング装置の制御回路12は、信号級16を介して、各部の位置動作状態の信号を入力し、各部への動作命令を行っている。

次に本実施例の動作について説明する。

まず、上下駆動手段 6 ,前後駆動手段 7 により、ボンディングアーム 4 を前後 ,上下動させ、ダイ 1 をコレット 5 で真空吸着して、(図示しない) ダイ供給装置から被ボンディング材 2 のボンディング面 3 より僅か上方に移送する。この状態を示したのが、第 2 図である。

との状態から、次に制御回路12より真空を切る命令が出され、コレット5に吸着保持されてい

ィング面と前記ダイとの間に僅かな険間を持たせた位置で、前記ダイの吸着保持状態を解放して前記コレットと前記ダイとを分離した後、前記コレットと前記ダイとが接近して前記被ポンディング材のポンディング面上で前記ダイを押圧保持し、スクラブ動作を行い、ダイポンディングを終了することを特徴とする。

〔実施例〕

次に本発明について図面を参照して説明する。 第1図は本発明の第1の実施例のダイボンディング方法で使用する製造装置を示す側面図である。 同図において、本実施例のダイボンディング方法 では、まずダイを被ボンディング材2のボンディング面3に移送して、ダイボンディングを行う為 のポンディングアーム4の先端部下面には、ダイ 1の吸着保持用のコレット5が設けられているも のが用意される。

このボンディングアーム4は、その上端において、上下駆動手段6に支持され、この下に設けられた前後駆動手段7に支持され、ダイ1を(図示

たダイ1は吸着から解放され、フリーの状態になり、第3図の如く、ボンディング面3上へなじん だ状態で載置される。

次に、ポンディングアーム4を下降させ、コレット5により第4図の様に、ダイ1をポンディング面3へ押圧保持し、カム11の回転により、ダイ1はスクラブ動作を開始し、ポンディング面3上にAu-Si共晶で短時間に接合させることができる。

第5図(a)乃至第5図(c)は本発明の第2の実施例のダイポンディング方法を工程順に示す断面図である。まず第5図(a)において、本第2の実施例では、ヒータブロック上下駆動手段17により、被ボンディング材2をあらかじめ下方へ下降させた状態のところへ、ダイ1をコレット5で真空吸着して、(図示しない)ダイ供給位置から被ボンディング材2のボンディング面3の値か上方への実に、次に第5図(b)に示すように、コレット5の真空を切って、ダイ1をボンディング面3上へフリーの状態で載置させる。その後、第5図(c)に示す

ように、ヒータプロック上下駆動手段17により、 4. 図面の簡単な説明 被ポンディング材2を上昇させ、コレット5がダ イ1をポンディング面3上へ押圧保持し、スクラ プ動作を行ってダイポンディングを終了させる。

本第2の実施例では、ダイ1の移送後の上下勛 作を被ポンディング材2側とし、ポンディングア ームの動作と分離させたため、ダイ1の移送後の 上下動作を比較的簡単な機構で実現できるという 利点がある。

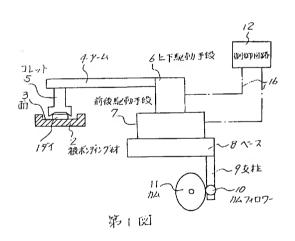
[発明の効果]

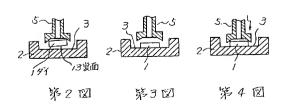
以上説明したように、本発明は、被ポンディン グ材のボンディング面上にフリーの状態で橄欖さ れたダイをコレットが押圧保持することにより、 ダイの裏面とポンディング面との均一な密着が行 え、大形のダイでも従来の小形ダイと同様に容易 かつ確実にダイボンディングすることが可能とな り、ダイの割れや欠け等の不良を防止すると共に、 タイポンディング装置の安定稼動に寄与できる効 果がある。

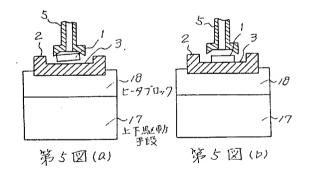
第1図は本発明の第1の実施例のダイポンディ ング方法で使用するダイポンディング装置を示す 伽面図、第2図、第3図、第4図は第1図のダイ ポンディング方法を順に示す断面図、第5図(a), 維5 図(b), 第5 図(c)は本発明の第2の実施例のダ イポンディング方法で使用する装置を示す断面図、 第6図は従来のタイポンディング方法の欠点を示 す断面図である。

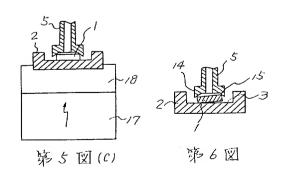
1 ……ダイ、2 ……被ボンディング材、3 …… ポンディング面、 4 …… ポンディングアーム、 5 ……コレット、6……上下駆動手段、7……前後 **歇動手段、8……ペース、9……支柱、10……** カムフォロワ、11……カム、12……ダイボン ディング制御回路、13……ダイ裏面、14…… テーパ部、15……ダイ裏面のコーナ、16…… 信号線、17……ヒータプロック上下駆動手段、 18 ……ヒータプロック。

> 代理人 弁理士 晋 内









PAT-NO: JP401200639A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01200639 A

TITLE: DIE BONDING

PUBN-DATE: August 11, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

OKAMURA, MINORU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

NEC CORP N/A

APPL-NO: JP63025267

APPL-DATE: February 4, 1988

INT-CL (IPC): H01L021/52

US-CL-CURRENT: 156/60 , 156/538

ABSTRACT:

PURPOSE: To perform uniform and close contact of the rear of a die with a bonding face and to surely execute a die bonding operation of even a large die by a method wherein the die placed, in a free state, on the die bonding face of a material to be bonded is pressed and held by means of a collet.

CONSTITUTION: A collet 5 installed at a bonding

arm 4 sucks and holds a die 1; it transfers the die to a part which is situated a little above a bonding face of a material 2 to be bonded; a sucked and held state of the die is released in a position having a small gap between the bonding face and the die; the collet is separated from the die; after that, the collet is approached to the die; the die is pressed and held on the bonding face of the material to be bonded; a scrubbing operation is executed; a die bonding operation is completed. By this setup, an accident such as a crack, a breakage or the like is not caused; a good bonding state between the die and the material to be bonded can be obtained.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio